

晶圓廠 ELLIPSOMETER 保養程序

壹、目的

貳、適用時機

參、適用範圍

肆、使用材料

伍、使用工具

陸、安全事項

柒、內容

捌、生效與修訂

NO. :	G3363-1023	VERSION :	<u>D</u>	PAGE :	2
-------	------------	-----------	----------	--------	---

晶圓廠 ELLIPSOMETER 保養程序

壹、目的：

定期校正維護機台正常運作。

貳、適用時機：

WPM：7天±2天。

MPM：一個月(±2週)。

參、適用範圍：

ELLIPSOMETER 量測機台。

肆、使用材料：

IPA,小白布,潤滑油... 等。

伍、使用工具：

鐘錶起子,六角板手,水平儀... 等。

陸、安全事項：

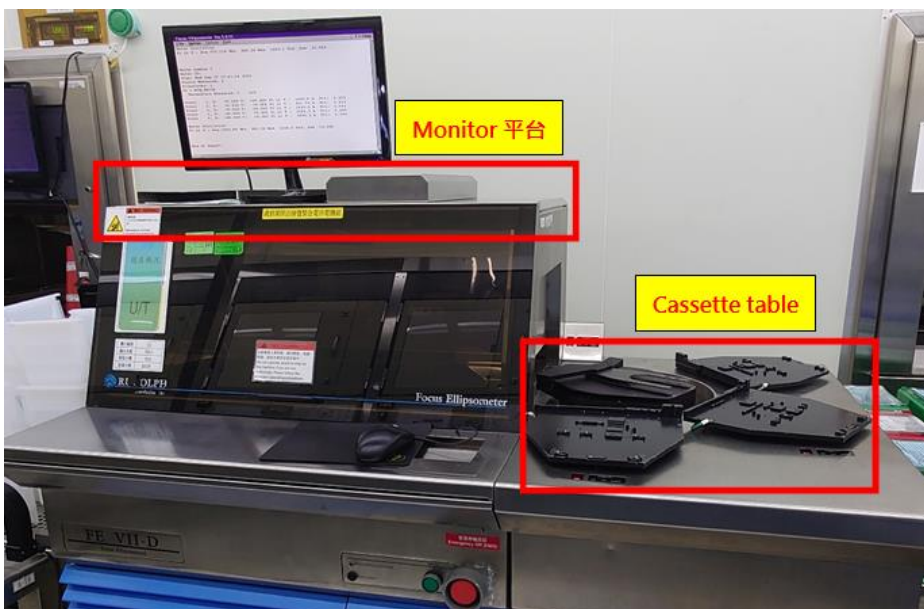
使用化學品,應穿戴防護器具。

NO. :	G3363-1023	VERSION :	<u>D</u>	PAGE :	3
-------	------------	-----------	----------	--------	---

柒、內容：

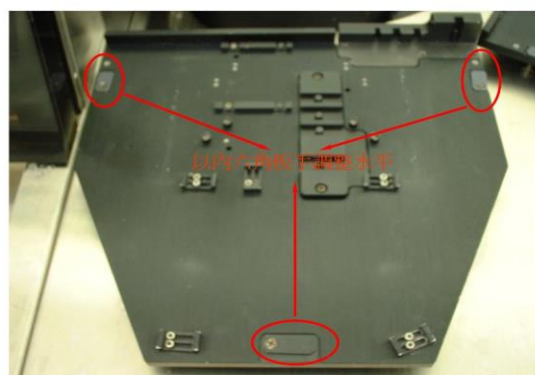
WPM 保養內容：

1. Monitor 平台表面以無塵布沾 IPA (異丙醇) 進行擦拭。
2. Cassette table 以無塵布沾 IPA (異丙醇)進行擦拭。



MPM 保養內容：

1. 以水平儀檢查 TABLE & ROBOT 是否水平。
2. 若否則以內六角板手調整之。



NO. :	G3363-1023	VERSION :	<u>D</u>	PAGE :	4
-------	------------	-----------	----------	--------	---

3. 準備 1 LOT D/W 置放於 TABLE 。
4. 輸入傳送指令『LWXY』(X 指 CASSETTE 1 & 2 & 3 ; Y 指 CASSETTE 上之第 Y 片)。
5. 觀察 ROBOT 進入 CASSETTE 抓 WAFER 時之高低位置。
6. 調整高低參數：

輸入指令：CALSET CAS_BASE

ENTER CASSETTE (1 OR 2 OR 3)：輸入欲調整之 CASSETTE 位置 X

ENTER WAFER SIZE (100mm,125mm,150mm,200mm)：輸入尺寸

CASSETTE X SIZE 150mm CASSETTE BASE：3960 STEPS (未修改前之參數)

ENTER CASSETTE BASE (0~100000)：輸入欲修改參數

CONTINUE WITH ANOTHER CASSETTE BASE (Y/N)：N

7. 左右及前後校正：

輸入指令：AUTOCAL 21

出現如下訊息：

Do you wish for this routine to modify the "cas_roation" value (y/n)? (key in 『y』)

Enter Cassette (『1』 or 『2』 or 『3』)：輸入欲調整之 CASSETTE 位置 X

Enter wafer slot (『1』 ~ 『25』)：(一般以 12 or 13 片為基準)

Enter flat or notch：(key in 『flat』)

Place cassette on platform(Hit enter)：(Cassette 置放 ok)

Please wait , calibration in progress Eccentricity：3435

(此數值必須低於 2000)Continue (y/n)? (key in 『n』)

(視上列數值是否於規格內，若 ok 則選 『n』，否則選 『y』)

若選則 y 請於 wafer 傳回 cassette 後將 wafer 推至與 cassette 抵到才能確保校正的位置沒變
當步驟完成時會出現一些機台自己校正的參數，這些參數為機台針對剛剛執行的校正所產生，
機台會自動修正儲存。

(左右 & 前後校正亦必須每個 CASSETTE 個別調整)

捌、生效與修訂

本規範之公佈實施及其修訂核准層級皆依會簽/核決/分發依循範例為之。